

PCT

世界知的所有権機関
国際事務局
特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 H01L 21/68	A1	(11) 国際公開番号 WO99/28965
		(43) 国際公開日 1999年6月10日(10.06.99)

(21) 国際出願番号 PCT/JP97/04372

(22) 国際出願日 1997年12月1日(01.12.97)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

大日商事株式会社(DAINICHI SHOJI K.K.)(JP/JP)

〒108 東京都港区芝浦4-15-13 Tokyo, (JP)

ローツェ株式会社(RORZE CORPORATION)(JP/JP)

〒720-21 広島県深安郡神辺町宇道上1588番地の2

Hiroshima, (JP)

株式会社 荏原製作所(EBARA CORPORATION LTD.)(JP/JP)

〒144 東京都大田区羽田旭町11-1 Tokyo, (JP)

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ)

大山幸次(OHYAMA, Koji)(JP/JP)

中山俊哉(NAKAYAMA, Toshiya)(JP/JP)

〒108 東京都港区芝浦4-15-13

大日商事株式会社内 Tokyo, (JP)

崎谷文雄(SAKIYA, Fumio)(JP/JP)

金原峰雄(KINPARA, Mineo)(JP/JP)

〒720-21 広島県深安郡神辺町宇道上1588番地の2

ローツェ株式会社内 Hiroshima, (JP)

藤井敏昭(FUJII, Toshiaki)(JP/JP)

堀田 修(HORITA, Osamu)(JP/JP)

〒251 神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1

株式会社 荏原総合研究所内 Kanagawa, (JP)

(74) 代理人

弁理士 川和高穂(KAWAWA, Takaho)

〒108 東京都港区芝五丁目14番16号 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 JP, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: CONTAINER AND LOADER FOR SUBSTRATE

(54)発明の名称 基板のコンテナ及びローダ

(57) Abstract

A closed container conveys semiconductors to prevent contamination due to dust and the like. In order to fabricate semiconductors, a container is placed on a loader mounted on a side of a low-level clean room and on a border between a high level clean room and the low-level clean room. When a cover of the container is made integral with a door provided on an opening of a loader to descend in the loader, the container and the high-level clean room are opened to enable semiconductors to move between the container and the high-level clean room. Since all mechanical components, which generate dust, are placed on the side of the low-level clean room, cleanliness on a side of the high-level clean room can be kept high.

